

磁界掃印 CPW-FMR 測定による Ni-Fe 薄膜のダンピング定数の評価

遠藤 恒, 山口 正洋 (東北大工)

Study on the Damping Constant of Ni-Fe Thin Films Using Field-domain CPW-FMR Measurements

Yasushi Endo, Masahiro Yamaguchi (Tohoku Univ.)

はじめに 強磁性共鳴 (Ferromagnetic Resonance: FMR) 測定は、バルクや薄膜からなる磁性体のダンピング定数 α を評価する測定法の 1 つとして知られている¹⁾. 近年、外部磁界を固定して、ベクトルネットワークアナライザを用いて周波数掃印させたコプレーナウェーブガイドによる強磁性共鳴 (Coplanar waveguide-FMR: CPW-FMR) 測定がいくつかの研究グループにより提案されている²⁻⁴⁾. この測定では、CPW の狭い信号線上に高周波磁界を集中させることができるために, cavity を用いた従来の FMR 測定とは異なり、幅広い周波数帯域で磁性薄膜だけでなく微小磁性体の計測が可能である. また、磁性薄膜における磁化の過渡応答も計測できる. 本研究では、新たに周波数を固定して外部磁界を掃印させた CPW-FMR 測定により、Ni-Fe 薄膜におけるダンピング定数 α の膜厚依存性を検討した. また、得られた結果について、従来の周波数掃印させた CPW-FMR 測定により評価した結果との比較検討を行った.

実験方法 CPW の作製には、フォトリソグラフィ、DC マグネットロンスパッタおよびリフトオフ法を用いた. 作製した CPW の形状は一端が終端された 1 ポート型形状であり、その膜構成はガラス基板 (厚さ : 550 μm , 比誘電率 ϵ_r : 7.0) 上に製膜させた Cr (5 nm)/Cu (300 nm)/Cr (5 nm) 積層膜である. CPW の線路長、信号線幅、グラウンド線幅および信号線とグラウンド線間のギャップ幅は 1000, 50, 88 および 12 μm とした. 薄膜試料の作製には、RF マグネットロンスパッタを用いた. 薄膜の構成は、熱酸化 Si 基板上に製膜した 3-50 nm 厚の Ni-Fe 薄膜である.

作製した Ni-Fe 薄膜における保磁力と飽和磁化の評価には VSM を、またダンピング定数 (α) の評価には、磁界掃印および周波数掃印 CPW-FMR 測定を用いた.

結果 磁界掃印 CPW-FMR 測定により得られた 5 nm 厚の Ni-Fe 薄膜における s_{11} の実部の外部磁界による変化を図 1 に示す. いずれの周波数帯においてもディップが観測され、その位置は周波数の増加とともにより高い磁界側へ移動している. これらのディップは Ni-Fe 薄膜の FMR に起因している. したがって、観測された FMR ピークの半値幅 ΔH と、そのときの周波数 f との関係からダンピング定数 α を算出した.

図 2 は磁界掃印および周波数掃印 CPW-FMR 測定により求めた Ni-Fe 薄膜における α の膜厚依存性である. いずれの測定の場合も、 α の膜厚に対する変化はほぼ類似している. すなわち、10 nm 厚より薄い膜厚では α は急激に低下している. この原因是、より薄い膜厚において物質固有のダンピングに加えて膜表面で外的要因によるダンピングが発生していることによるものと考えられる. また、3 nm 厚の場合には磁界掃印と周波数掃印の測定により α の値が大きく異なっている. この差異は観測された FMR ピーク波形の対称性の違いに由来するものと考えられる. 一方、10 nm 厚以上の膜厚において α はほぼ一定であり、その値は 0.009~0.011 程度であり、Ni-Fe のバルク値 (0.007) に比べて大きくなっている. この原因是、主に膜中の磁気不均一性 (磁化の異方性分散) によると考えられる.

謝辞 本研究は科研費基盤研究(B) (No. 26289082), 挑戦的萌芽 (No. 26630296), 情報ストレージ研究推進機構(SRC)の協力のもとで行われた.

参考文献 1) J. H. E. Griffiths, Nature 148, 670 (1946).

2) G. Counil *et al.*, J. Appl. Phys. 95, 5646 (2004).

3) M. Toda *et al.*, J. Magn. Soc. Jpn. 31, 435 (2007).

4) Y. Endo *et al.*, J. Appl. Phys. 109, 07D336 (2011).

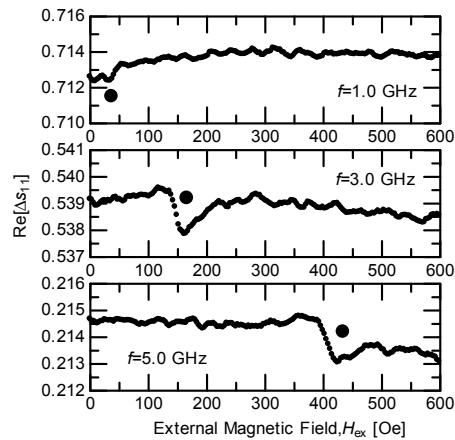


Fig. 1 Field dependence of $\text{Re}[\Delta s_{11}]$ for CPW with 5-nm-thick Ni-Fe film at frequencies.

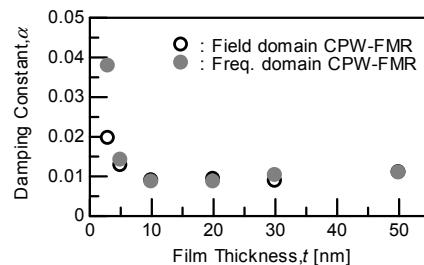


Fig. 2 Thickness dependence of damping constant α for Ni-Fe film measured with field domain and frequency domain CPW-FMR measurements.

マイクロ波磁場により励起された Co/Pt 多層膜 ドットのナノビーム X 線磁気円二色性測定

菊池伸明¹, 岡本聰¹, 北上修¹, 島津武仁¹, 鈴木基寛²

(¹東北大, ²JASRI/SPring-8)

Nano-beam XMCD measurement on a Co/Pt multilayer dot excited by microwave field

N. Kikuchi¹, S. Okamoto¹, O. Kitakami¹, T. Shimatsu¹, M. Suzuki²

(¹Tohoku Univ., ²JASRI/Spring-8)

はじめに

Pt を含む多層膜や合金は大きな磁気異方性を発現できることから応用上も重要であり、幅広い研究の対象となっている。磁性層と Pt 層を積層した場合、その界面においては Pt 原子に大きな磁気モーメントが誘起されることが知られている[1]。また、そのような系においては、磁性金属単層に比べてダンピングが著しく大きく増加することが報告されており[2]、その理解が重要となっている。しかしながら、一般的な磁気的・電気的測定手法では界面で分極した Pt の挙動のみを分離して議論することは困難である。そこで、本研究においては元素選択性を持つ X 線磁気円二色性 (X-ray Magnetic Circular Dichroism : XMCD) を用いることで、rf 磁場により励起された Co/Pt 多層膜ドット中の分極した Pt 原子の挙動について調べた。

実験方法・結果

Co/Pt 多層膜は MgO(100) 基板上に sub./Ta(0.5)/Pt(1)/Ru(24)/Pt(0.5)/[Co(1.4)/Pt(0.5)]₆/Ru(10) の構成で DC マグネットロンスパッタリングにより成膜した。数字は各層の膜厚で単位は nm である。多層膜を電子線リソグラフィー・Ar イオンエッチングにより直径 3 μm のディスク状に加工し、異常 Hall 効果(AHE)検出用の電極および高周波磁界印加用の伝送線路（幅 3 μm）を形成した。伝送線路を用いて膜面内方向の rf 磁場を発生すると、強磁性共鳴条件において歳差運動が誘起されることで膜面に垂直な磁化成分が変化する。この変化を異常 Hall 効果および XMCD により検出した。なお、XMCD の測定は SPring-8 のビームライン BL39XU にて実施し、Pt の L₃ 吸収端を用いた。磁化の垂直成分に感度を持つように X 線は膜面に垂直に入射した。図 1 に、異常 Hall 効果により測定した直径 3 μm のドット一個の磁化曲線を示す。点線は rf 磁場を印加せずに、実線は周波数 $f_{rf} = 3 \text{ GHz}$ 、振幅約 400 Oe の rf 磁場を印加した状態で測定した結果である。直流磁場 H_{dc} は膜面に垂直に印加し、掃引方向は正から負方向である。 $H_{dc}=3 \text{ kOe}$ 近傍に強磁性共鳴による明瞭なディップが現れており、その形状は大振幅の歳差運動を反映して非対称な形状を示す。図 2 に、 $f_{rf}=2.8 \text{ GHz}$ の rf 磁場下で測定した XMCD（実線）の結果を、異常 Hall 効果（●）の結果と合わせて示した。いずれも飽和値で規格化し、磁化の垂直成分 M_z として示した。XMCD の測定は約 300 nm 径のナノビームで行い、ドットの中心付近で計測した。強磁性共鳴ピークの位置・形状・強度が双方の測定手法においてよく一致しており、Co 層に挟まれた Pt 層がほぼ一様に歳差運動をしていることが示唆された。

参考文献 [1] M. Suzuki *et al.*, PRB 72, 054430 (2005), [2] S. Mizukami *et al.* APL 96, 152502 (2010)

謝辞 本研究の一部は、文科省「ナノマクロ物質・デバイス・システム創製アライアンス」および科研費、JST「戦略的イノベーション創出推進プログラム(S-イノベ)」ならびに SRC からの援助の下行われた。

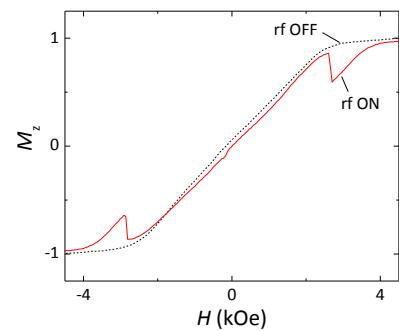


Fig. 1 AHE curves of single Co/Pt multilayer dot measured with and without rf fields ($f_{rf} = 3 \text{ GHz}$).

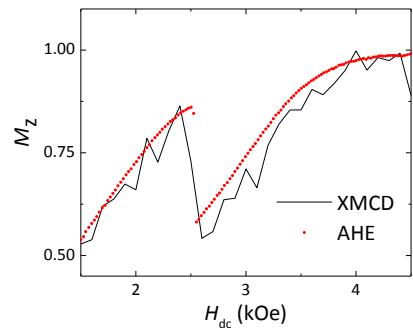


Fig. 2 Magnetization curves of a Co/Pt multilayer dot measured by XMCD and AHE under application of rf field ($f_{rf} = 2.8 \text{ GHz}$).

マイクロ波アシスト磁化反転と強磁性共鳴の 同一 Co/Pt ナノドット試料での測定

草薙勇作, 岡本 聰, 菊池伸明, 北上 修, 島津武仁
(東北大)

Relationship between microwave assisted magnetization switching and ferromagnetic resonance of Co/Pt nanodots.

Y. Kusanagi, S. Okamoto, N. Kikuchi, O. Kitakami, and T. Shimatsu
(Tohoku Univ.)

はじめに

マイクロ波アシスト磁化反転 (MAS: Microwave Assisted magnetization Switching) は次世代超高密度記録技術の有力候補として注目を集めている。MASにおいては、磁気モーメントに GHz 帯域の交流磁場を印加することで磁気モーメントの歳差運動が誘起され、その結果反転磁場が大幅に低減される。励起モードとしては、ドット径に依存して一様励起だけでなく、高次のスピン波励起も MAS 挑動に大きく影響することが MAS 実験とシミュレーションの比較から分かっている¹⁾。しかし、実際の励起モードと MAS 挑動の相関は実験的にはまだ確認されていない。本研究では励起モードと MAS 挑動の関係を調べるために、異常 Hall 効果による強磁性共鳴測定 (AHE-FMR: Anomalous Hall Effect based Ferromagnetic Resonance)²⁾と MAS 実験を同一の Co/Pt ナノドット試料に対して行ったので、その結果について報告する。

実験方法と結果

実験に用いた膜構成は、MgO sub./Ta(2 nm)/Pt(25 nm)/[Co(1.1 nm)/Pt(0.5 nm)]_s/Pt(10 nm)とした。成膜には DC マグネットロンスパッタを用いた。この多層膜を EB リソグラフィにより加工し、同一基板上にドットアレイを形成した。AHE 測定用の電極およびマイクロ波交流磁場印加用の Cu 線路もあわせて形成した。ドットアレイのドット直径は 80 ~ 1000 nm でドット間距離は 60 ~ 200 nm とした。ドットアレイの配置領域は約 5 × 5 μm² である。MAS, FMR いずれの測定でも dc 磁場 H_{dc} を膜面に垂直に -6 ~ 6 kOe の範囲で印加し、Cu 線路に高周波電流を印加し交流磁場 $h_{rf} = 200$ Oe を膜面内に印加した。AHE-FMR 測定では歳差運動による磁化の垂直成分の変化を異常 Hall 電圧の変化量として検出する。ただし、得られる信号が微弱であるため高周波電流を矩形波で振幅変調し、同期した Hall 効果の変化をロックインアンプで検出した。Fig. 1 にドット直径 160 nm、ドット間距離 60 nm のドットアレイで得られた異常 Hall 電圧の変化量 ΔV_{AHE} を示す。交流磁場周波数 f_{rf} の増加に伴い高磁場側にシフトする複数のディップが確認できる。高磁場側のディップ (Fig. 1 の ▼) は一様モード ($m=1$)、低磁場側のディップ (Fig. 1 の ▽) は高次のモード ($m=2$) によるものである。Fig. 2 に AHE-FMR 測定より得られた共鳴磁場 H_r と MAS 測定より得られた反転磁場 H_{sw} を交流磁場周波数 f_{rf} の関数として示す。図中の H_{sw} のエラーバーは反転磁場の分散を表している。 H_{sw} はアシスト効果により f_{rf} の増加に伴い単調に減少し $f_{rf} = 3$ ~ 10 GHz の範囲で最大 0.8 kOe の H_{sw} の低減が確認できた。これは過去に Co/Pt ナノドットで報告された結果¹⁾に比べ小さな H_{sw} 減少であり、またプロードな MAS 挑動となっている。この原因としてはドット間距離が狭いことによる粒子間相互作用の影響が考えられる。 H_r は $m=1, 2$ いずれのモードも f_{rf} に対して線形な変化を示しており、今回得られた MAS 効果は $m=1$ の一様モードの点線におおよそ対応する結果が得られた。

参考文献

- 1) M. Furuta *et. al.*, *J. Appl. Phys.* **115**, 133914 (2014).
- 2) N. Kikuchi *et. al.*, *Appl. Phys. Lett.* **105**, 242405 (2014).

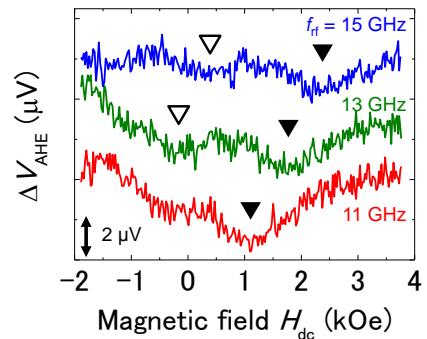


Fig. 1 AHE voltage change ΔV_{AHE} as a function of dc field H_{dc}

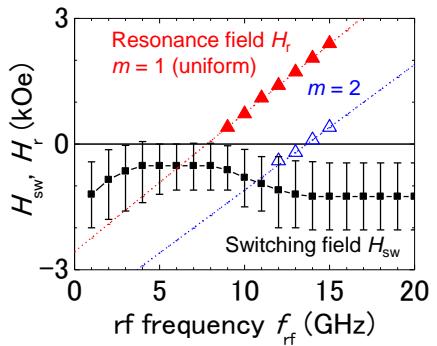


Fig. 2 Resonance field H_r and switching field H_{sw} as a function of rf frequency f_{rf} .

Switching probability analysis on epitaxial Co/Pt multilayer single nanodots

B. Lao, S. Okamoto, N. Kikuchi, and O. Kitakami

(Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University)

Magnetization switching is a fundamental function of various magnetic devices, such as magnetic recording, spintronics, permanent magnets, and so on. Thus understanding the magnetization switching behavior in a single small magnetic particle is essentially important to develop the high performance magnetic devices. The underlying physics of magnetization switching has been discussed through various experiments and simulations in Co/Pd and Co/Pt multilayers [1-3], which are important materials for practical applications due to their tunable perpendicular magnetic anisotropy. Through these large number efforts, it has been widely accepted that a nucleation of a reversed domain with a dimension of domain wall width initiates the magnetization reversal of the dot. These previous experiments, however, were carried out in polycrystalline samples, many of intrinsic switching properties would be hidden behind some distributions of magnetic and geometric properties. In this study, we have investigated the magnetization switching behavior in a series of single nanodots of epitaxially grown Co/Pt multilayer.

The film structure is Sapphire(001)/Pt 20/[Co 0.8/Pt 0.5]₄/Pt 1.5 (in nm). All deposition processes are performed at room temperature after substrate annealing at 800 °C for 1 h. The epitaxial growth of Co/Pt film with fcc (111) structure is well confirmed by x-ray diffraction measurements. The Co/Pt film is patterned into single nanodots with diameters d varying from 120 nm to 1.6 μm by using electron beam lithography and Ar ion etching. Subsequently, the Pt underlayer is patterned into a cross-shaped electrode for anomalous Hall effect (AHE) measurements. An example of scanning electron microscope (SEM) image of a Co/Pt dot of $d = 200$ nm is shown in Fig. 1. The magnetization switching of the dots is detected by an AHE curve under a vertical dc field H_{dc} from an electromagnet.

Magnetization curves of the single Co/Pt dots exhibit a rectangular shape, and show a Stoner-Wohlfarth like angular dependence of coercivity, which suggesting a nucleation reversal mechanism in the dots with bi-stability magnetized states. To analyze the switching process, switching probability P_{sw} of the dot is evaluated by repetition of magnetization curve measurements. The P_{sw} plotted as a function of H_{dc} is well fitted by the Néel-Arrhenius law $P_{sw} = 1 - \exp\{-tf_0 \exp[-E_b/k_B T]\}$. The behaviors of P_{sw} changes drastically below and above $d = 400$ nm, indicating the change of energy barrier E_b . The fitting analysis on the P_{sw} by assuming a simple energy barrier function of $E_b = E_0(1 - H_{dc}/H_0)^n$ gives the intrinsic switching field H_0 and energy barrier height $E_0/k_B T$, as shown in Fig. 2. Note that these two parameters exhibit dramatic change at $d \sim 400$ nm, strongly indicating the change of reversal mechanism. For $d < 400$ nm, the value of E_0 can be well explained by the single barrier of reversed embryo. On the other hand, $d > 400$ nm, the evaluated value of E_0 by assuming simple energy barrier function is hard to be explained, suggesting the somewhat complicated reversal mechanism, such as multi-barrier.

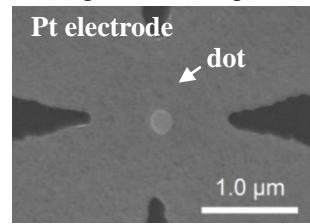


Fig.1. SEM image of a single dot with $d = 200$ nm with a Pt electrode.

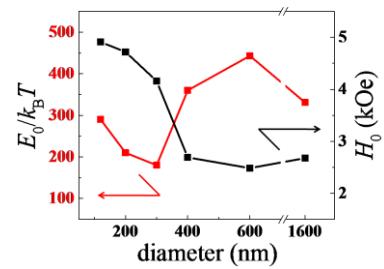


Fig.2. $E_0/k_B T$ (black circle) and H_0 (red square) as functions of dot diameter d .

Reference

- 1) J. W. Lau, X. Liu, R. C. Boling, and J. M. Shaw, Phys. Rev. B, **84**, 214427 (2011).
- 2) N. Kikuchi, S. Okamoto, and O. Kitakami, J. Appl. Phys. **109**, 07B904 (2011).
- 3) M. Delalande, J. de Vries, L. Abelmann, and J. C. Lodder, J. Magn. Magn. Mater., **324**, 1277-1280 (2012).

強磁性細線アレイにおけるスピノン波励起と検出

葛西伸哉¹、塚原宙²、平山重之^{1,3}、三谷誠司^{1,3}、三俣千春¹、小野寛太²
(物材機構¹、高エネ研²、筑波大院数理³)

Spin wave coupling in ferromagnetic wire arrays

S. Kasai¹, H. Tsukahara², S. Hirayama^{1,3}, S. Mitani^{1,3}, C. Mitsumata¹, and K. Ono²
(NIMS¹, KEK², University of Tsukuba³)

はじめに

近年、スピントロニクス分野では、純スピノン流を用いた磁化ダイナミクスの励起と制御が注目を集めている。中でもスピノンホール効果は高効率に純スピノン流を生成することができるため、現在精力的に研究が行われている^{1,2)}。本研究では特異なスピノン波バンド構造を有するアンチドット格子におけるスピノン流誘起ダイナミクスに注目をした。強磁性細線アレイから構成されるアンチドット構造は、細線および交点から構成される振動子の結合系としてとらえることができるため、スピノン波相互作用を調べるうえで良いモデル系となることが期待される。

実験方法

試料は RF スパッタ法で成膜した Permalloy/Pt 二層膜を、電子線リソグラフィーおよび Ar イオンミリング法を用いることで作製した。図 1 に典型的な試料の SEM 像を示す。線幅は 100 nm、格子の周期は 500 nm である。高周波電流を試料に印加することによって、交流磁場およびスピノン流を生成し、異方性磁気抵抗効果を用いたホモダイン検波によって、スピノン波の検出を行った。また周期的境界条件を課した Landau – Lifschitz – Gilbert 方程式を数値的に解くことによって、スピノン波ダイナミクスの詳細について検討を行った。

結果

図 2 に $\theta=60\text{--}90^\circ$ におけるスペクトルを示す。 $\theta=90^\circ$ では単一の共鳴ピークが観測されているのに対して、 $\theta=60\text{--}80^\circ$ では二つのピークに分裂する様子が明瞭に観測されている。これは、図中 a 方向の細線と、b 方向の細線で有効磁場の大きさが異なるためである。一方、低磁場側に現れるピークの強度は高磁場側に現れるピークの強度よりも大きい。マイクロマグネティクス計算によれば、 $\theta=90^\circ$ の場合には交点部分の磁化が動かないのに対して、 $\theta=80^\circ$ の場合には、交点部分に磁化の運動が誘起されている。言い換えれば、外部磁場の方向によって、交点を介したスピノン波相互作用の強度が制御可能であることを表している。

参考文献

- 1) V. E. Demidov *et al.*, Nat. Mater. 11, 1028 (2012)
- 2) S. Kasai *et al.*, Appl. Phys. Lett. 104, 092408 (2014)

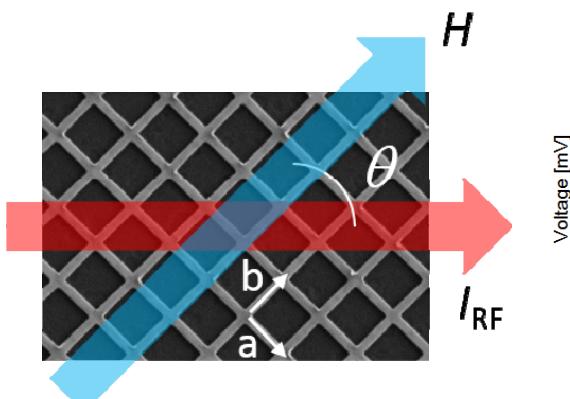


Fig. 1 SEM image of a sample.

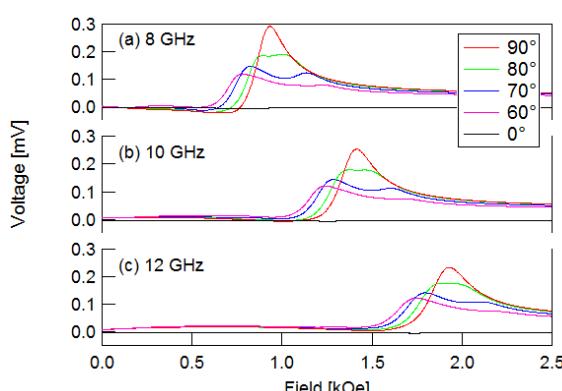


Fig. 2 ST-FMR spectrum under various conditions.

Pt(2nm)/GdFeCo(100nm)二層膜における電流駆動磁壁移動

黒川雄一郎、川本将也、栗野博之¹⁾

(豊田工業大学)

Current induced domain wall motion in Pt(2nm)/GdFeCo(100nm) bilayer magnetic wires

Yuichiro Kurokawa, Masaya Kawamoto and Hiroyuki Awano

(Toyota Technological Institute)

序論

電流による磁壁の駆動は、レーストラックメモリをはじめとした新規な磁気メモリや論理素子への応用が期待されるスピントロニクスの新しい研究分野である。これまでの研究で、我々のグループでは磁気光学記録媒体などに用いられる TbFeCo では磁壁を駆動するための臨界電流密度が $5.8 \times 10^{10} \text{ A/m}^2$ という小さな値になることを発見した。GdFeCo は TbFeCo と同じく磁気光学記録媒体に用いられる希土類磁性材料である。今回の研究ではこの GdFeCo を用いて電流駆動磁壁移動を観察した。

実験方法

試料の成膜はスパッタリング装置を用いて行った。GdFeCo を 100nm 成膜後に試料の酸化を防ぐために 2nm の Pt 層を GdFeCo 上に堆積した。試料の細線への加工は電子ビームリソグラフィーとリフトオフ法を用いて行った。加工した細線の幅は 1.5um で、長さは 20um である。この細線に 20ns のパルス幅を持つパルス電流を印加することで電流駆動磁壁移動を観察した。電流駆動磁壁移動はカーポローブ顕微鏡を用いて観察した。

実験結果

Fig. 1 に Pt/GdFeCo 磁性細線の電流密度に対する磁壁速度を示した。図によると Pt/GdFeCo 磁性細線の臨界電流密度は $1.16 \pm 0.04 \times 10^{11} \text{ A/m}^2$ 程度である。また、電流密度 $J = 1.55 \times 10^{11} \text{ A/m}^2$ 程度で磁壁速度 $v = 36 \text{ m/s}$ に到達することが分かった。さらに、磁壁は電流によって、電流方向に駆動されることも分かった。通常の電流駆動磁壁移動では、伝導電子のスピノ角運動量の受け渡しによって磁壁を駆動するので、磁壁は電流とは逆方向、電子の移動方向と同じ方向に移動する。一方、最近の研究ではスピノ軌道相互作用の大きい重金属と磁性体の界面ではスピノホール効果とジャロシンスキー・守谷相互作用の発現によって電流方向に磁壁が移動することが示されている。しかしながら、これらの効果は界面で発現するため、長距離の相関を持たず厚い細線では発現しないと考えられる。実際に、Ueda らによると、Pt/[Co/Ni]_n 多層膜の場合、その膜厚が増していくと界面の影響が小さくなり、6.6nm 以上の Co/Ni 膜厚では磁壁が電流方向とは逆に駆動することが示されている。¹⁾ 今回の研究では、我々は 100 nm という、非常に厚い GdFeCo 磁性膜を用いている。このことから、今回の我々の結果は、GdFeCo 磁性細線中ではスピノホール効果やジャロシンスキー・守谷相互作用といった界面における相互作用が従来の磁性細線に比べ界面から十分に長い距離であっても維持されることを示していると考えられる。

参考文献

- 1) K. Ueda, K. J. Kim, Y. Yoshimura, R. Hiramatsu, D. Chiba, H. Tanigawa, T. Suzuki, E. Kariyada and T. Ono, Appl. Phys. Express 7, 053006 (2014)

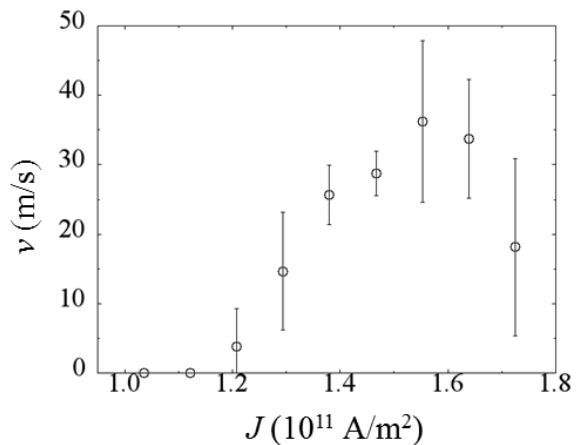


Fig. 1 GdFeCo 磁性細線における磁壁速度 v と電流密度 J との関係

[Co/Pd]磁性細線への磁区形成における軟磁性下地層の効果

奥田 光伸^{1,2}、宮本 泰敬¹、川那 真弓¹、宮下 英一¹、斎藤 信雄¹、林 直人¹、中川 茂樹²

(¹NHK 放送技術研究所、²東京工業大学大学院)

Effect of Soft Underlayer on Formation of Magnetic Domains in [Co/Pd] Nanowire

M. Okuda^{1,2}, Y. Miyamoto¹, M. Kawana¹, E. Miyashita¹, N. Saito¹, N. Hayashi¹ and S. Nakagawa²

(¹NHK, ²Tokyo Institute of Technology)

はじめに

近年、磁性細線における磁壁の電流駆動に関する研究¹⁾に注目が集まり、レーストラックメモリ²⁾に代表される新しい原理のメモリが提案されている。とりわけ磁性細線を並列に複数配置し、それらの磁区を電流印加によって同期駆動できれば、並列アクセスによる超高速磁気記録デバイスを実現することが期待される³⁾。そこで我々は、[Co/Pd]垂直磁化磁性細線中の磁区をパルス電流により高速駆動させる新しい記録デバイスの基礎研究を進めている。HDD用磁気ヘッドに内在するTMR型再生ヘッド部を、2次元コンタクトスキャナすることによって試料の表面磁化状態を観察する nano-MDS (Magnetic Domain Scope for wide area with nano order resolution)⁴⁾法を用いて、同じく内在する記録ヘッド部によって磁性細線中に磁区を形成した後、パルス電流印加によりその磁区を駆動し、再生ヘッド部によりその変異を検出することに既に成功している。しかしながら再生ヘッドによる駆動磁区の検出感度は非常に高いものの、記録ヘッドによる磁区形成が安定して実現できていないため、記録ロスを生じる問題があった。今回、ハードディスク媒体と同様に[Co/Pd]層の下部に軟磁性下地層(SUL)を導入し、その磁路安定効果と記録効率の向上について検証したので報告する。

実験方法

イオンビームスパッタ法および電子線リソグラフィーにより、それぞれ(a)SULなし、(b) Ni₈₁Fe₁₉ SUL(30 nm)、(c) Ni₇₉Fe₁₆Mo₅ SUL(30 nm)、の上に[Co/Pd]垂直磁化多層膜を表面熱酸化Si基板上に30 nm堆積して磁性細線を作製した。細線幅は150 nm、細線長は20 μmとした。nano-MDSの記録ヘッド部により、下向き磁界を印加しながら磁性細線表面を走査してその磁化方向をすべて下向きにそろえて初期化した後、記録ヘッドを細線上の任意点で固定して上向き磁界を印加し、その記録磁区構造の変化を再生ヘッド部によって観察した。

実験結果

Fig.1は(a)、(b)、(c)、それぞれのSUL条件において、[Co/Pd]磁性細線と記録ヘッドの細線幅方向の相対位置に対する、安定した磁区形成に必要な臨界記録ヘッド電流の関係を示したものである。磁性細線の中心ではすべての細線において、ほぼ同じヘッド電流で磁区を形成することができているが、SULがない細線では記録ヘッドが中心から離れると磁区を形成するために大きな電流を必要とすることがわかった。このことから、SULを設けることにより、記録ヘッドからの磁束が細線中に集中する磁路が形成され、磁性細線端部においても安定に磁区を形成しやすくなるものと考えられる。講演では、SUL磁性膜の材料組成と形状の変化に対して、臨界記録ヘッド電流の変化や記録した磁区の電流駆動の挙動について報告する。

参考文献

- 1) H. Tanigawa *et al.*: *Appl. Phys. Express*, **2**, 053002 (2009).
- 2) S. S. P. Parkin *et al.*: *Science*, **320**, 190 (2008).
- 3) 宮本他: 映像情報メディア学会誌, **68**, (1), J34 (2014).
- 4) 近松他: 日本磁気学会会報まぐね, **6**, (6), 357 (2011).

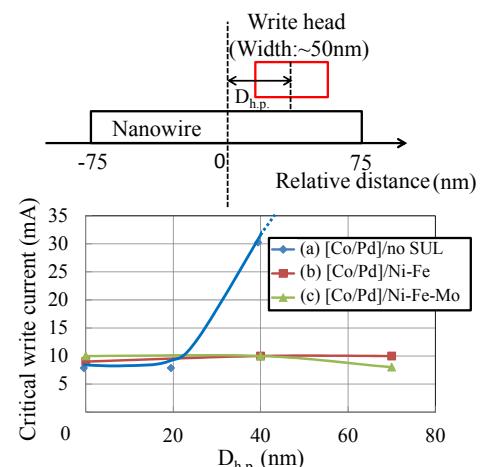


Fig.1 Relative distance between the center of nanowire and write-head dependence of critical current for writing magnetic domains.